## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ** 

# Конструирование и технология вакуумных систем

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.03 25 00 МИРЭА.plx

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого		
Недель	1	6			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	32	32	32	32	
Лабораторные	16	16	16	16	
Практические	16	16	16	16	
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35	
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2	
Итого ауд.	66,35	66,35	66,35	66,35	
Контактная работа	66,35	66,35	66,35	66,35	
Сам. работа	33	33	33	33	
Часы на контроль	44,65	44,65	44,65	44,65	
Итого	144	144	144	144	

г. Рязань

УП: 11.03.03\_25\_00\_МИРЭА.plx

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Грачев Евгений Юрьевич

Рабочая программа дисциплины

#### Конструирование и технология вакуумных систем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 928)

составлена на основании учебного плана:

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

# Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотре исполнения в 2026-2027 учебно Промышленной электроники	м году на заседании кафедры	
	Протокол от 2026 г. №	
	Зав. кафедрой	
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2027-2028 учебно <b>Промышленной электроники</b>	ом году на заседании кафедры	
	Протокол от 2027 г. №	
	Зав. кафедрой	
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники	на, обсуждена и одобрена для м году на заседании кафедры	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для м году на заседании кафедры	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для м году на заседании кафедры	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от2028 г. №	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от2028 г. №	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от 2028 г. №  Зав. кафедрой  Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году  на, обсуждена и одобрена для	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники Рабочая программа пересмотре	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от 2028 г. №  Зав. кафедрой  Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники  Рабочая программа пересмотре исполнения в 2029-2030 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от 2028 г. №  Зав. кафедрой  Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры	

УП: 11.03.03 25 00 МИРЭА.plx

#### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является формирование у студентов: знаний в области техники получения и измерения вакуума, умений решать задачи, связанные с проектированием вакуумных систем и установок.

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	<b>Д</b> икл (раздел) ОП:	Б1.B
2.1	Требования к предварі	ительной подготовке обучающегося:
2.1.1		ируется на следующих дисциплинах учебного плана: «Физика», «Математика», нерная и компьютерная графика».
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2.1	Выполнение и защита в	ыпускной квалификационной работы
2.2.2	Преддипломная практив	ra

# 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен выполнять работы по проектировнию несложного вакуумного технологического обрудования электровакуумного и полупроводникового производства

#### ПК-1.1. Выполняет проектирование вакуумной системы несложного вакуумного технологического оборудования

#### Знать

основные правила составления схем вакуумных установок технологического оборудования, принципы работы и условия эксплуатации форвакуумных и высоковакуумных насосов различных типов, назначение вспомогательных узлов вакуумных систем

#### Уметь

составлять принципиальные и структурные вакуумные схемы технологического оборудования, рассчитывать характеристики необходимого вакуумного насосного оборудования и вспомогательных узлов

#### Владеть

в области применения средств автоматизированного проектирования вакуумных схем, технологий монтажа вакуумного оборудования, разъемных вакуумных соединений различного типа

# ПК-1.2. Выполняет проектирование систем заземления, блокировочных устройств, защитных кожухов и ограждений несложного вакуумного технологического обрудования

#### Знать

основные правила составления схем заземления вакуумных установок технологического оборудования, виды блокировочных устройств и алгоритмы их работы, устройство защитных кожухов и ограждений

#### Умети

составлять схемы заземления вакуумных установок технологического оборудования, выполнять расчет контуров заземления, применять различные виды блокировочных устройств

#### Владеть

в области расчета систем и контуров заземления установок питания и управления вакуумного технологического оборудования

#### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные правила составления схем вакуумных установок технологического оборудования, принципы работы и условия эксплуатации форвакуумных и высоковакуумных насосов различных типов, назначение вспомогательных узлов вакуумных систем, основные правила составления схем заземления вакуумных установок технологического оборудования, виды блокировочных устройств и алгоритмы их работы, устройство защитных кожухов и ограждений.
3.2	Уметь:
3.2.1	составлять принципиальные и структурные вакуумные схемы технологического оборудования, рассчитывать характеристики необходимого вакуумного насосного оборудования и вспомогательных узлов, составлять схемы заземления вакуумных установок технологического оборудования, выполнять расчет контуров заземления, применять различные виды блокировочных устройств.
3.3	Владеть:
3.3.1	в области применения средств автоматизированного проектирования вакуумных схем, технологий монтажа вакуумного оборудования, разъемных вакуумных соединений различного типа, в области расчета систем и контуров заземления установок питания и управления вакуумного технологического оборудования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Форма
занятия		Курс		ции		контроля

	Раздел 1. Основные принципы, методы и устройства получения и измерения вакуума					
1.1	Свойства газов при низких давлениях /Тема/	7	0			
1.2	Газовые законы. Испарение, конденсация, понятия "газ", "пар". Тепловое движение молекул. Давление с точки зрения МКТ. Понятие вакуума. Диффузия газов. Теплопроводность и внутреннее трение газов. Взаимодействие молекул газа с поверхностью. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.3	Газовые законы. Испарение, конденсация, понятия "газ", "пар". Тепловое движение молекул. Давление с точки зрения МКТ. Понятие вакуума. Диффузия газов. Теплопроводность и внутреннее трение газов. Взаимодействие молекул газа с поверхностью. /Ср/	7	3	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.4	Газовые законы. Испарение, конденсация, понятия "газ", "пар". Тепловое движение молекул. Давление с точки зрения МКТ. Понятие вакуума. Диффузия газов. Теплопроводность и внутреннее трение газов. Взаимодействие молекул газа с поверхностью. /Экзамен/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.5	Теоретические основы процесса откачки /Тема/	7	0			
1.6	Быстрота откачки объема и быстрота действия насоса. Виды течения газа. Пропускная способность отверстия. Сопротивление и пропускная способность вакуумпровода. Пропускная способность трубопровода переменного сечения. Основное уравнение вакуумной техники. Расчет длительности откачки. /Лек/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.7	Расчет сопротивления и пропускной способности трубопровода круглого сечения, и трубопровода переменного сечения. /Пр/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.8	Быстрота откачки объема и быстрота действия насоса. Виды течения газа. Пропускная способность отверстия. Сопротивление и пропускная способность вакуумпровода. Пропускная способность трубопровода переменного сечения. Основное уравнение вакуумной техники. Расчет длительности откачки. /Ср/	7	3	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.9	Быстрота откачки объема и быстрота действия насоса. Виды течения газа. Пропускная способность отверстия. Сопротивление и пропускная способность вакуумпровода. Пропускная способность трубопровода переменного сечения. Основное уравнение вакуумной техники. Расчет длительности откачки. /Экзамен/	7	7	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.10	Методы получения вакуума. /Тема/	7	0			
1.11	Классификация насосов. Основные параметры вакуумных насосов. Объемные механические насосы. Молекулярные и турбомолекулярные насосы. Пароструйные насосы. Диффузионные насосы. Геттерные насосы. Магниторазрядные насосы. Криадсорбционные и криконденсационные насосы. /Лек/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы

УП: 11.03.03\_25\_00\_МИРЭА.plx cтр.

1.12       Расчет скорости откачки объемных вращательных насосов различных типов. /Пр/       7       4       ПК-1.1-3 Л1.3 Л ПК-1.1-В ПК-1.1-В Л2. ПК-1.1-В Л2. ПК-1.2-З ПК-1.2-З ПК-1.2-З ПК-1.2-В ПК-1.2-В ПК-1.2-В ПК-1.2-В ПК-1.2-В ПК-1.1-В	I2.2 вопросы .1 I3.1
ПК-1.1-В   Л2.   ПК-1.2-З   Л2.3 Л   ПК-1.2-У   Э1   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З   Л1.3 Л   ПК-1.1-У   Л1.1 Л   ПК-1.1-У	.1 I3.1
ПК-1.2-3   Л2.3Л   ПК-1.2-У   Э1   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-У   Л1.1Л   ПК-1.1-У   Л1.1Л   ПК-1.1-У   Л1.1Л   ПК-1.1-У   ПК-1	13.1 I
ПК-1.2-3   Л2.3Л   ПК-1.2-У   Э1   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-У   Л1.1Л   ПК-1.1-У   Л1.1Л   ПК-1.1-У   Л1.1Л   ПК-1.1-У   ПК-1	I
ПК-1.2-У ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З ПТ.3	I
1.13   Расчет скорости откачки физико-химических   7   4   ПК-1.1-3   Л1.3 Л насосов различных типов. /Пр/   ПК-1.1-У   Л1.1Л	
1.13       Расчет скорости откачки физико-химических насосов различных типов. /Пр/       7       4       ПК-1.1-3       Л1.3 Л ПК-1.1-У	П 2 Контрольные
насосов различных типов. /Пр/ ПК-1.1-У Л1.1Л	/   KOUTHOHLULIA
	1
ПК-1.1-В Л2.	
ПК-1.2-3 Л2.3Л	I3.1
ПК-1.2-У   Э1	1
ПК-1.2-В	
1.14 Изучение принципа работы и конструкции 7 4 ПК-1.1-3 Л1.3 Л	П1 2
объемных вращательных насосов. /Лаб/ ПК-1.1-У Л1.1Л	l l
ПК-1.1-В Л2.	l l
ПК-1.1-В Л2.3 Л2.3Л	l l
ПК-1.2-У Э1	·
ПК-1.2-В	
1.15 Изучение принципа работы и устройства турбо 7 4 ПК-1.1-3 Л1.3 Л	П1.2 Отчет по
-молекулярного насоса. /Лаб/   ПК-1.1-У   Л1.1Л	I2.2 лабораторной
ПК-1.1-В   Л2.	.1 работе
ПК-1,2-3 Л2,3Л	
ПК-1.2-У Э1	
ПК-1.2-В	
1.16 Классификация насосов. Основные параметры 7 6 ПК-1.1-3 Л1.3 Л	П1.2 Контрольные
	1
	1 *
насосы. Молекулярные и турбомолекулярные ПК-1.1-В Л2.	I
насосы. Пароструйные насосы. Диффузионные ПК-1.2-3 Л2.3Л	
насосы. Геттерные насосы. Магниторазрядные ПК-1.2-У Э1	L
насосы. Криадсорбционные и ПК-1.2-В	
криконденсационные насосы /Ср/	
1.17 Классификация насосов. Основные параметры 7 7 ПК-1.1-3 Л1.3 Л	П1.2 Контрольные
вакуумных насосов. Объемные механические ПК-1.1-У Л1.1Л	
насосы. Молекулярные и турбомолекулярные ПК-1.1-В Л2.	1 1
насосы. Пароструйные насосы. Диффузионные	I
насосы. Геттерные насосы. Магниторазрядные ПК-1.2-У Э1	
насосы. Криадсорбционные и ПК-1.2-В	
криконденсационные насосы /Экзамен/	
1.18 Измерение общих и парциальных 7 0	
давлений. /Тема/	
1.19 Механические деформационные вакуумметры. 7 4 ПК-1.1-3 Л1.3 Ј	П1.2 Контрольные
Гидростатические вакуумметры. Тепло-вые ПК-1.1-У Л1.1Л	І2.2 вопросы
вакуумметры. Электронные ионизационные ПК-1.1-В Л2.	
вакуумметры. Магнитные электрораз-рядные ПК-1.2-3 Л2.3Л	
вакуумметры. Емкостные вакуумметры.  ПК-1.2-У  Э1	I
Методы измерения парциальных дав-лений.  ПК-1.2-В	
Статические магнитные газоанализаторы.	
Времяпролетный масс-спектрометр.	
Омегатрон. /Лек/	71.2
1.20 Изучение устройства и принципа работы 7 4 ПК-1.1-3 Л1.3 Л	I
тепловых и ионизационных манометров. /Лаб/ ПК-1.1-У Л1.1Л	1 1 1
ПК-1.1-В Л2.	1 1
	I3.1
	[
ПК-1.2-У Э1	
ПК-1.2-У Э1 ПК-1.2-В	П.2 Контрольные
ПК-1.2-У   Э1   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   1.21   Расшифровка масс-спектра квадрупольного   7   4   ПК-1.1-З   Л1.3	
ПК-1.2-У ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-У ПК-1.1-У ПТ-1.1-У	I2.2 вопросы
ПК-1.2-У ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.1-В ПК-1.1-В ПТ-1.1-В	I2.2 вопросы .1
ПК-1.2-У ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-З   ПК-1.1-У   ПК-1.1-В   ПК-1.1-В   ПК-1.2-З   Л2.3 Л	I2.2 вопросы .1 I3.1
ПК-1.2-У ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.2-В   ПК-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-З ПТ-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.1-В ПК-1.1-В ПТ-1.1-В	I2.2 вопросы .1 I3.1

1.22	Механические деформационные вакуумметры. Гидростатические вакуумметры. Тепло-вые вакуумметры. Электронные ионизационные вакуумметры. Магнитные электроразрядные вакуумметры. Емкостные вакуумметры. Методы измерения парциальных давлений. Статические магнитные газоанализаторы. Времяпролетный масс-спектрометр. Омегатрон /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.23	Механические деформационные вакуумметры. Гидростатические вакуумметры. Тепло-вые вакуумметры. Электронные ионизационные вакуумметры. Магнитные электроразрядные вакуумметры. Емкостные вакуумметры. Методы измерения парциальных давлений. Статические магнитные газоанализаторы. Времяпролетный масс-спектрометр. Омегатрон. /Экзамен/	7	4,65	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.24	Измерение газовых потоков. Методы течеискания. /Тема/	7	0			
1.25	Методы измерения газовых потоков. Метод двух манометров. Метод постоянного давления. Метод постоянного объема. Косвенные методы измерения газовых потоков. Количественная оценка течи вакуумной системы. Манометрический метод. Гелиевый течеискатель. /Лек/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.26	Определение наличия течи в вакуумной камере методом пробного газа. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Отчет по лабораторной работе
1.27	Методы измерения газовых потоков. Метод двух манометров. Метод постоянного давления. Метод постоянного объема. Косвенные методы измерения газовых потоков. Количественная оценка течи вакуумной системы. Манометрический метод. Гелиевый течеискатель. /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.28	Работа с гелиевым течеискателем. Основные приемы, схемы течеискания. /ИКР/	7	0,35	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
1.29	Методы измерения газовых потоков. Метод двух манометров. Метод постоянного давления. Метод постоянного объема. Косвенные методы измерения газовых потоков. Количественная оценка течи вакуумной системы. Манометрический метод. Гелиевый течеискатель /Экзамен/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы
	Раздел 2. Основные этапы конструирования, сборки и испытания вакуумных систем					
2.1	Элементы вакуумных систем /Тема/	7	0			
2.2	Вакуумпроводы. Запорная арматура. Типы разборных и неразборных вакуумных соединений. Типы фланцевых соединений. Вакуумная сварка и пайка. Вакуумные электрические вводы. Вакуумные вводы движения. Ловушки. /Лек/	7	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1	Контрольные вопросы

2.3	Вакуумпроводы. Запорная арматура. Типы	7	5	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2	Контрольные
	разборных и неразборных вакуумных соединений. Типы фланцевых соединений.			ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1Л2.2 Л2.1	вопросы
	Вакуумная сварка и пайка. Вакуумные			ПК-1.2-3	Л2.3Л3.1	
	электрические вводы. Вакуумные вводы			ПК-1.2-У	Э1	
	движения. Ловушки /Ср/			ПК-1.2-В		
2.4	Вакуумопроводы. Запорная арматура. Типы	7	6	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2	Контрольные
	разборных и неразборных вакуумных со-			ПК-1.1-У	Л1.1Л2.2	вопросы
	единений. Типы фланцевых соединений.			ПК-1.1-В	Л2.1	
	Вакуумная сварка и пайка. Вакуумные			ПК-1.2-3	Л2.3Л3.1	
	электрические вводы. Вакуумные вводы			ПК-1.2-У	Э1	
2.5	движения. Ловушки. /Экзамен/ Вакуумные материалы и уплотнения /Тема/	7	0	ПК-1.2-В		
2.6	Материалы, используемые в вакуумной	7	4	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2	Контрольные
	технике. Вакуумные стекла. Керамические и			ПК-1.1-У	Л1.1Л2.2	вопросы
	силикатные материалы. Органические			ПК-1.1-В	Л2.1	
	материалы. Типы вакуумных уплотнений. /Лек/			ПК-1.2-3	Л2.3Л3.1	
				ПК-1.2-У	Э1	
2.7	M	7	A	ПК-1.2-В	птапта	I/ and the
2.7	Материалы, используемые в вакуумной технике. Вакуумные стекла. Керамические и	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2	Контрольные
	силикатные материалы. Органические и			ПК-1.1-У	Л1.1Л2.2 Л2.1	вопросы
	материалы. Типы вакуумных уплотнений. /Ср/			ПК-1.1-В	Л2.3Л3.1	
	материалы. Типы вакуумных уплотнении. /Ср/			ПК-1.2-У	Э1	
				ПК-1.2-В		
2.8	Материалы, используемые в вакуумной	7	6	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2	Контрольны
	технике. Вакуумные стекла. Керамические и			ПК-1.1-У	Л1.1Л2.2	вопросы
	силикатные материалы. Органические			ПК-1.1-В	Л2.1	1
	материалы. Типы вакуумных			ПК-1.2-3	Л2.3Л3.1	
	уплотнений. /Экзамен/			ПК-1.2-У	Э1	
2.9	Очистка и монтаж элементов вакуумных	7	0	ПК-1.2-В		
	систем /Тема/	,				
2.10	Виды загрязнений в вакуумной технике.	7	4	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2	Контрольные
	Загрязнения деталей соединениями хлора, серы			ПК-1.1-У	Л1.1Л2.2	вопросы
	и углеводородами. Методы очистки деталей и			ПК-1.1-В	Л2.1	
	контроль чистоты. Ультразвуковая очистка			ПК-1.2-3	Л2.3Л3.1	
	деталей. Основные правила монтажа фланцевых соединений. /Лек/			ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Э1	
2.11	Виды загрязнений в вакуумной технике.	7	4	ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.2	Контрольные
∠.11	Загрязнения деталей соединениями хлора, серы	_ ′	"	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2	вопросы
	и углеводородами. Методы очистки деталей и			ПК-1.1-В	Л2.1	Вопросы
	контроль чистоты. Ультразвуковая очистка			ПК-1.1-В	Л2.3Л3.1	
	деталей. Основные правила монтажа			ПК-1.2-У	312.3313.1	
	фланцевых соединений. /Ср/			ПК-1.2-В		
2.12	Виды загрязнений в вакуумной технике.	7	6	ПК-1.1-3	Л1.3 Л1.2	Контрольны
	Загрязнения деталей соединениями хлора, серы			ПК-1.1-У	Л1.1Л2.2	вопросы
	и углеводородами. Методы очистки деталей и			ПК-1.1-В	Л2.1	
	контроль чистоты. Ультразвуковая очистка			ПК-1.2-3	Л2.3Л3.1	
	деталей. Основные правила монтажа			ПК-1.2-У	Э1	
2.12	фланцевых соединений. /Экзамен/	7	2	ПК-1.2-В	П1 1 П2 2	Voumeaux
2.13	Консультация перед экзаменом /Кнс/	/	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У	Л1.1Л2.3	Контрольны
				ПК-1.1-У		вопросы
				ПК-1.1-В		
				ПК-1.2-У		
				ПК-1.2-У		
				11IX-1.Z-D		

# 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС 6.1. Рекомендуемая литература		
		6.1.1. Основная литература		
No	Артори и осоторитоли	Заглавие	Издательство,	Количество/
Nō	Авторы, составители		год	название ЭБС
Л1.1	Грачев Е.Ю., Фефелов А.А., Трубицын А.А.	Физические основы вакуумной техники: учеб. пособие : Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2024,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/3939
Л1.2	Хабланян М. Х., Саксаганский Г. Л., Бурмистров А. В.	Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, эксплуатация. Часть 2. Вакуумные насосы : учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследователь ский технологическ ий университет, 2016, 300 с.	978-5-7882- 1977-6, http://www.ip rbookshop.ru/ 79274.html
Л1.3	Хабланян М. Х., Саксаганский Г. Л., Бурмистров А. В.	Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, эксплуатация. Часть 1. Инженерно-физические основы : учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследователь ский технологическ ий университет, 2013, 233 с.	978-5-7882- 1447-4, http://www.ip rbookshop.ru/ 61961.html
	1	6.1.2. Дополнительная литература		•
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Розанов Л.Н.	Вакуумная техника : Учеб.для вузов	М.:Высшая школа, 1990, 320 с	5-06-000479- 1, 1
Л2.2	Шешин Е.П.	Вакуумные технологии : учеб. пособие	Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2009, 504c.	978-5-91559- 012-9, 1
Л2.3	Грачев Е.Ю., Фефелов А.А., Трубицын А.А.	Физические основы вакуумной техники: учеб. пособие	Рязань, 2024, 92c.	, 1
		6.1.3. Методические разработки		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Шатохин В. Л., Шестак В. П.	Вакуумная техника: лабораторный практикум	Москва: НИЯУ МИФИ, 2010, 84 с.	978-5-7262- 1255-5, http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_id=75757
	6.2. Переч	ень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети	"Интернет"	
Э1	ВАКУУМНАЯ ТЕХНИ Вакуумные системы дл	IKA ія любых отраслей науки и промышленности // https://vacuum.ru	u	

#### 6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

#### 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

-F				
Наименование	Описание			
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО			
LibreOffice	Свободное ПО			
MathCAD	Коммерческая лицензия			
SolidWorks	Коммерческая лицензия			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1 Система КонсультантПлюс http://ww	ww.consultant.ru			

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1	103 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий, компьютерный класс Специализированная мебель (24 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ
2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины

КАФЕДРЫ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ КАФЕДРЫ

подписано ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ ВЫПУСКАЮЩЕЙ

**30.08.25** 19:05 (MSK)

30.08.25 19:05 (MSK) Простая подпись

Простая подпись